

497413-2026 - Hange

Saksamaa – Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid) – Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

OJ S 136/2026 17/07/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Asjad

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

E-posti aadress: wahl@ifos.uni-kl.de

Hankija õiguslik vorm: Hankija subsideeritavat lepingut sõlmiv organisatsioon

Hankija tegevus: Haridus

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

Kirjeldus: Los1: DualBeam Focused Ion Beam Systems (FIB) Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines DualBeam Focused Ion Beam Systems (FIB) einschließlich Einweisung/Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los1.25-1696.05.techn.Anforderungsprofil" und "Los1.25-1696.06.Wertungsmatrix". Los2: Transmissionselektronenmikroskop (TEM) Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines Transmissionselektronenmikroskops (TEM) einschließlich Einweisung/Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los2.25-1707.05.techn.Anforderungsprofil" und "Los2.25-1707.06.Wertungsmatrix".

Menetluse tunnus: b3e6743d-bfc2-4cac-a001-90b28790bddb

Sisemine tunnus: 25-1696-1707

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

Menetluskorra kirjeldus: Die Vergabe erfolgt in zwei Losen (Los 1: FIB, Los 2: TEM). Bieter, die Angebote für beide Lose abgeben, können zusätzlich ein Gesamtangebot (Kombinationsangebot) einreichen. Das Kombinationsangebot muss auf den angebotenen Einzel-Angeboten zu beiden Losen basieren; der Leistungsumfang des Kombinationsangebotes muss den Leistungsumfängen der Angebote auf die Einzellöse entsprechen. Das Kombinationsangebot ist zusätzlich zu den losweisen Angeboten einzureichen und muss: - einen gesonderten Gesamtpreis für beide Lose (unter Berücksichtigung etwaiger Preisvorteile, z. B. Rabatte), sowie - eine Darstellung eines etwaigen losübergreifenden wissenschaftlichen, technischen, funktionalen oder organisatorischen Mehrwerts einer gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform enthalten. Etwaige Preisvorteile werden ausschließlich im Zuschlagskriterium "Preis" berücksichtigt. Ein losübergreifender Mehrwert wird ausschließlich im Zuschlagskriterium "Technik" bewertet und setzt voraus, dass dieser über die Bewertung der Einzellöse

hinausgeht und sich aus dem Zusammenwirken beider Systeme ergibt. Die Bewertung der Kombinationsangebote erfolgt nach denselben Zuschlagskriterien. Zusätzlich werden losübergreifende Aspekte wie die vollständige wissenschaftliche Prozesskette einer Probe - von der Präparation im FIB über den qualitätserhaltenden Proben transfer und die korrelative Untersuchung im TEM bis hin zum gemeinsamen Datenmanagement und der nachvollziehbaren Dokumentation der Untersuchungsergebnisse berücksichtigt. Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag entweder losweise oder losübergreifend zu erteilen.

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 38000000 Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid)

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Riik: Saksamaa

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: #Bekanntmachungs-ID: CXP4DNMMUBY#

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

vgv -

2.1.5. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada: 2

Lepingutingimused:

Nende osade maksimaalne arv, mille kohta võib sõlmida lepingu ühe pakkujaga: 2

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Teade

Ainult siseriiklikest kõrvalejätmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine:

Kuritegelikus ühenduses osalemine:

Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised:

Rahapesu või terrorismi rahastamine:

Pettus:

Korruptsioon:

Laste tööjõu kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid:

Maksude tasumise kohustuse rikkumine:

Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine:

Keskkonnaõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine:

Sotsiaalõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine:

Tööõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine:

Maksejõuetus:

Vara haldab likvideerija:

Äritegevus on peatatud:

Siseriikliku õiguse kohane samalaadne olukord, näiteks pankrot:

Tõsine ametialane rikkumine:

Konkurentsi moonutamise eesmärgil teiste ettevõtjatega sõlmitud kokkulepped:

Hankemenetluses osalemisega kaasnev huvide konflikt:

Otsene või kaude osalemine käesoleva hankemenetluse ettevalmistamisel:

Ennetähtaegne lõpetamine, kahjutasu või võrreldavad sanktsioonid:

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB)

Kirjeldus: Ziel dieses Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines Dual-Beam-FIB/REM-Systems (Focused Ion Beam / Rasterelektronenmikroskop) einschließlich analytischer Detektorsysteme, Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Das System dient primär der präzisen Probenpräparation (u.a. TEM-Lamellen, APT-Spitzen, Querschnitte und Defektfreilegungen) und sekundär der hochauflösenden bildgebenden, chemischen und strukturellen Charakterisierung (SEM, EDX, STEM, EBSD) im selben System. Das Gerät wird als zentrale Präparations- und Analyseplattform für wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Typische Anwendungen umfassen u. a. Batterie- und Elektrodenmaterialien, Wasserstoffspeichermaterialien, katalytische Schichten, Metalle/Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen und Multilayer-Systeme. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - reproduzierbarer, möglichst automatisierter TEM-Lamellen- und APT-Präparation (Lift-Out, Thinning, Polishing) - 3D-Analytik (Serienschliff/Tomographie) mit quantitativer Auswertung - hochaufgelöster Abbildung in verschiedenen SEM-Modi incl. Ioneninduzierter Sekundärionen sowie korrelierter Bildgebung während der Bearbeitung - chemischer Analytik mittels EDX und kristallographischer Analytik mittels EBSD Darüber hinaus ist eine strukturierte Erfassung und Exportfähigkeit von Messdaten und Metadaten in gängige, nicht-proprietäre Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfügbarkeit und Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfüllen. Das System muss die präzise Probenpräparation und -strukturierung mittels Ionenstrahl sowie die begleitende und nachfolgende Abbildung und Analytik mittels SEM und anderen Detektorsystemen ermöglichen. Ziel ist die reproduzierbare Präparation von Proben für TEM und APT sowie die Durchführung von 2D/3D-Analysen (Bildgebung (SE, STEM), EDX, EBSD) einschließlich vollständiger Dokumentation der Bearbeitungs- und Messparameter. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Materialabtrag/Strukturierung (manuell und automatisiert) mit definierbaren Pattern- und Rezeptfunktionen. 2. TEM-Lamellenpräparation inkl. In-situ Lift-Out, Thinning und abschließender Feinpolitur. 3. APT-Spitzenpräparation (Needle Milling) inkl. reproduzierbarer Geometrie. 4. Korrelierte Echtzeit-Bildgebung im SEM während der FIB-Bearbeitung (Navigation/Endpunktkontrolle). 5. Chemische Analytik mittels EDX sowie kristallographische Analytik mittels EBSD (Punkt, Linie, Mapping). 6. 3D-Workflows (Serienschliff/Tomographie) mit dokumentierter Rekonstruktion bzw. Export der Datensätze. 7. Workflow und Datenmanagement: eindeutige Zuordnung von Bearbeitungs-/Messdaten, Parametern und Metadaten; Export in nicht proprietäre Formate.

Sisemine tunnus: 1

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 38000000 Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid)

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei ole nõutud

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade

Kriteerium: Viited määratud tarnetele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten für ein Los sind Referenzen für vergleichbare Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten für beide Lose können Referenzen für beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgeführte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexität dem jeweils angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme; Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen müssen den vollständigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht älter als drei Jahre sein.

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Preis (Angebote auf Einzellose und Kombinationsangebote)

Kirjeldus: Für das Zuschlagskriterium Preis erhält das Angebot mit dem niedrigsten (gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis über dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 50

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Technik (Angebote auf Einzellose bzw. Kombinationsangebote)

Kirjeldus: Für das Zuschlagskriterium Technik werden ausschließlich die nachgewiesenen technischen Leistungsparameter von im Dokument 06. Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische Übererfüllung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet. Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemäß Dokument "06. Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Übererfüllung (wertungsrelevant)") des jeweiligen

Loses, multipliziert und anschließend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellöse sowie der Bewertung des zusätzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien für diesen Mehrwert sind: K1 durchgängiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualität des Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4 gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und Betriebskonzept Ergänzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf." Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 50

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg
Hankedokumentide aadress: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY/documents>
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:
URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 77 Päevad
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Angaben und Erklärungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.
Lepingutingimused:
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:
Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistootlused: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

5.1. Osa: LOT-0002

Pealkiri: Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

Kirjeldus: Gegenstand des Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines aberrationskorrigierten 200 kV Transmissionselektronenmikroskops (S/TEM) einschließlich analytischer Detektorsysteme, Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Das System dient als zentrale Analyseplattform für die hochauflösende strukturelle, chemische und elektronische Charakterisierung von Materialien auf atomarer und nanometergenauer Skala. Es wird sowohl für industrielle Auftragsanalytik als auch für wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Im Institut werden Materialien mit stark variierenden Eigenschaften untersucht, insbesondere Metalle, Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen, funktionale Schichtsysteme sowie nanostrukturierte Materialien. Die Proben unterscheiden sich hinsichtlich Geometrie, Stabilität gegenüber Elektronenstrahlbelastung sowie analytischer Fragestellungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - hochauflösender Abbildung bis in den atomaren Bereich - chemischer Analytik mittels EDX und EELS - Untersuchung von Grenzflächen und Defekten - Untersuchung magnetischer und funktionaler Materialien - reproduzierbaren Messungen über Probenserien hinweg Darüber hinaus ist eine strukturierte Erfassung und Exportfähigkeit von Messdaten und Metadaten in gängige, nicht-proprietäre Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfügbarkeit und Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfüllen. Das System muss die hochauflösende strukturelle, chemische und elektronische Analyse von festen, elektronenstrahlstabilen Proben im Transmissionselektronenmikroskopie- und Raster-Transmissionselektronenmikroskopie-Modus ermöglichen. Hierzu muss es eine präzise Elektronenoptik, stabile Betriebsbedingungen sowie integrierte analytische Detektionssysteme bereitstellen. Ziel ist die Untersuchung von Materialien bis in den atomaren Maßstab sowie die quantitative und qualitative Analyse von Struktur, Zusammensetzung und elektronischen Eigenschaften. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Hochauflösende

Abbildung (TEM und STEM): - Abbildung von Kristallstrukturen, Defekten, Grenzflächen und Nanostrukturen mit atomarer bzw. sub-nanometergenauer Auflösung. - Betrieb sowohl im konventionellen TEM- als auch im STEM-Modus. - Flexible Wahl geeigneter Abbildungsmodi (z. B. Bright Field, Dark Field, HAADF, ABF, Oberflächenbildgebung mit topografieabhängigem Kontrast). 2. Chemische und spektroskopische Analytik: - Elementanalytik mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX). - Analyse elektronischer und chemischer Zustände mittels Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS). - Durchführung von Punktanalysen, Linienprofilen sowie zweidimensionalem Mapping. 3. Untersuchung von Grenzflächen und Defekten: - Analyse von Phasengrenzen, Ausscheidungen, Korngrenzen und strukturellen Inhomogenitäten. - Untersuchung lokaler chemischer Variationen auf nanoskaliger Ebene. 4. Untersuchung funktionaler und magnetischer Materialien: - Möglichkeit zur magnetfeldfreien oder feldarmen Abbildung (z. B. Lorentz-Modus oder funktional gleichwertig), soweit erforderlich. 5. Automatisierter und reproduzierbarer Betrieb: - Reproduzierbare Einstellung von Messparametern und Speicherung von Messabläufen. - Unterstützung automatisierter Messreihen und Mapping-Experimente. 6. Workflow und Datenmanagement: - Eindeutige Zuordnung von Messdaten, Parametern und Metadaten. - Möglichkeit zur späteren Reproduktion von Messbedingungen. 7. Integration aller Detektoren und Betriebsmodi in eine konsistente Bedienumgebung.

Sisemine tunnus: 2

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 38000000 Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid)

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Muu kestus: Teadmata

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei ole nõutud

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade

Kriteerium: Viited määratud tarnetele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten für ein Los sind Referenzen für vergleichbare Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten für beide Lose können Referenzen für beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgeführte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexität dem jeweils

angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme; Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen müssen den vollständigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht älter als drei Jahre sein.

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Preis (Angebote auf Einzellöse und Kombinationsangebote)

Kirjeldus: Für das Zuschlagskriterium Preis erhält das Angebot mit dem niedrigsten (gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis über dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 50

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Technik (Angebote auf Einzellöse bzw. Kombinationsangebote)

Kirjeldus: Für das Zuschlagskriterium Technik werden ausschließlich die nachgewiesenen technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische Übererfüllung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet. Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemäß Dokument "06. Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Übererfüllung (wertungsrelevant)") des jeweiligen Loses, multipliziert und anschließend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellöse sowie der Bewertung des zusätzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien für diesen Mehrwert sind: K1 durchgängiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualität des Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4 gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und Betriebskonzept Ergänzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf."

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 50

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY/documents>

Sihtotstarbeline teavevahetuskanal:

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel

Elektroniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 77 Päevad

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.

Lisateave: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Angaben und Erklärungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.

Lepingutingimused:

Lepingu täitmise peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Registreerimisnumber: UStID DE148647541

Postiaadress: Trippstadter Straße 120

Linn: Kaiserslautern

Sihtnumber: 67663

Riik – jaotus (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: wahl@ifos.uni-kl.de

Telefon: +49 631205730

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft

Registreerimisnumber: UStID DE267215971

Postiaadress: Kramergasse 4

Linn: Dresden

Sihtnumber: 01067

Riik – jaotus (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: l.moerchen@eureos.de

Telefon: +49 39156286912

Selle organisatsiooni rollid:

Tugiteenuse osutaja

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Registreerimisnumber: 07-0001801100000-05

Postiaadress: Stiftsstraße 9

Linn: Mainz

Sihtnumber: 55116

Riik – jaotus (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de

Telefon: +49 6131162234

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0004

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53119

Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: c6abad07-e17d-4e42-b1fc-35d01bf3fcf6 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 15/07/2026 17:22:32 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 497413-2026

ELT S väljaande number: 136/2026

Avaldamise kuupäev: 17/07/2026